PACE PERFORMANCE PLASMA

A revolution in remote plasma ALD for High Volume Manufacturing 量産用リモートプラズマALDの革命

Gate dielectric by ALD for low damage ALDによる エッチングされた 低リーク誘電体 Recessed-aate High mobility V-threshold through 2D リセス型ゲート形成 electron gas (2DEG) at the AlGaN/GaN interface 2次元電子ガスの Buffer 高い移動

Plasma.oxinst.com/ALD

ATOMFAB

OXFORD